令和７年７月１日改訂

三次元半導体研究センター

機器利用料金について

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団

各料金について

■基本料金：クリーンルーム室料　　２，５００円／日・人
　　クリーンルーム以外室料　　１，０００円／日・人
　　① 上記の金額に、使用日数を乗じる
　　② 複数の者が使用する場合は、①にその人数を乗じる
　　③ 併用して使用する場合は、合算した金額

■機器利用料：各機器の時間単価（別紙１）に利用時間を乗じる

■工賃：別紙２のとおり

□基本料金＋機器利用料＋工賃（必要な場合のみ）
　　＋機器更新等特別付加料金＋消費税　を請求

（別紙１）

三次元半導体研究センター　機器利用料金単価表

（令和７年７月１日改訂）

No.	機器名	設置場所	料金（税抜）
7	乾燥炉200°C	クリーンルームＢ	3,000
9	予熱ラミネーター	クリーンルームＢ	3,200
11	クリーンローラ	クリーンルームＢ	2,400
12	真空ラミネータ	クリーンルームＢ	7,800
21	プリント基板用直接描画装置	クリーンルームＢ	29,800
23	乾燥炉360°C	クリーンルームＢ	3,000
23－2	乾燥炉	クリーンルームＥ	3,000
23－3	乾燥炉Si専用	クリーンルームＤ	3,000
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームＢ	6,900
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームＣ	4,100
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームＤ	5,700
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームＤ	8,400
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームＤ	3,000
46	オートマチックサーフェースグラインダー	クリーンルームＤ	11,500
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームＤ	7,800
49	ストレスリリーフ研磨装置	クリーンルームＤ	10,300
R1	高温クリーンオーブン	クリーンルームＤ	8,500
47	８インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームＥ	3,600
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームＥ	14,300
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルームＥ	8,300
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームＦ	15,700
51	絶縁膜形成装置	クリーンルームＦ	14,700
52	縦型酸化炉	クリーンルームＦ	8,200
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡	クリーンルームＦ	13,300
40	微細パターン加工装置	クリーンルームＧ	17,300
41	スピンコーター	クリーンルームＧ	4,900
42	アルカリデベロッパー	クリーンルームＧ	5,400
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	5,300
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	6,000
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,200
24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,800

No.	機器名	設置場所	料金（税抜）
32	内蔵部品検査装置	実装エリア	8,700
R5	熱衝撃試験機	実装エリア	1,300
13	乾燥炉200°C	水平ライン室	3,000
27	基板用現像装置	水平ライン室	11,200
28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	9,700
29	レジスト剥離装置	水平ライン室	14,500
31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	12,900
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室	7,500
34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	11,700
35	デスミア装置	めっきライン室	14,200
36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	12,200
37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	15,500
3	プリント基板用Ｘ線ガイド穴明機	機械加工室	5,900
4	プリント基板穴明機	機械加工室	6,500
5	プリント基板外形加工機	機械加工室	5,400
8	ピン立て装置	機械加工室	3,200
20	プリント配線板用ＵＶ＋CO_2レーザ加工機	機械加工室	15,800
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	8,100
61	衝撃試験装置	信頼性試験室	8,300
62	自動切断機	信頼性試験室	900
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室	4,100
57	プロービングシステム	電気特性評価室	3,400
R3	プロービングシステム（120GHz）	電気特性評価室	4,200
58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,900
59	ＴＤＲオシロスコープ	電気特性評価室	5,500
74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,900
R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	33,630
R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室	5,500
2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	10,700
L1	レーザー顕微鏡	検査室	4,700
L2	フリップチップボンダー	クリーンルームＣ	11,600
L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームＣ	5,700
L4	ボンドテスタ	クリーンルームＣ	4,000
L5	ＦＩＢ	クリーンルームＣ	13,400

No.	機器名	設置場所	**料金（税抜）**
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームＧ	**5,300**
L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルームＦ	**9,100**
80	反応性イオンエッチング装置	クリーンルームＦ	**10,500**
81	超音波探傷装置	実装エリア	**8,800**
82	有機溶剤現像装置	クリーンルームG	**9,000**
L9	ピール試験機	検査室	**3,300**
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	**2,500**
s1	ウェハ銅ポストめっき	クリーンルームＥ	**4,300**
s2	SnAgめっき	クリーンルームＥ	**4,300**
s3	電解Niめっき	クリーンルームＥ	**25,000**
s4	Ni/Auめっき	クリーンルームＥ	**50,800**
81	ドライフィルム剥離	クリーンルームＦ	**3,000**
s5	チタン/Cu　スパッタ	クリーンルームＦ	**40,600**
s6	二流体洗浄装置	クリーンルームＥ	**5,800**
s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	**102,000**
E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルームＣ	**1,700**

令和７年４月１日改訂　　（別紙２）

三次元半導体研究センター　工賃・技術料について

●技術工賃単価

・下記の操作サポート及び受託※を除き、36,000円／時

※受託は原則として実施しないが、実施する場合は78,000円／時

・従来の技術料は廃止

●操作サポート工賃単価

以下の機器については、操作方法の補助のみの場合、20,000円／時とする。

No.	機器名	設置場所
7	乾燥炉200°C	クリーンルームＢ
9	予熱ラミネーター	クリーンルームＢ
11	クリーンローラ	クリーンルームＢ
23	乾燥炉360°C	クリーンルームＢ
23－2	乾燥炉	クリーンルームＥ
23－3	乾燥炉Si専用	クリーンルームＤ
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームＢ
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームＣ
L4	ボンドテスタ	クリーンルームＣ
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームＤ
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームＤ
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームＤ
47	８インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームＥ
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームＧ
L1	レーザー顕微鏡	検査室
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室
3	プリント基板用Ｘ線ガイド穴明機	機械加工室
8	ピン立て装置	機械加工室
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア
32	内蔵部品検査装置	実装エリア
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室
61	衝撃試験装置	信頼性試験室
62	自動切断機	信頼性試験室
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)	信頼性試験室
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室